

研究タイトル：

材料実験、表面観察、表面形状測定



氏名：石橋 大作 / ISHIBASHI Daisaku E-mail: dai@ariake-nct.ac.jp

職名：技術専門職員 学位：

所属学会・協会：

キーワード：

技術相談

提供可能技術：

- ・授業科目：機械基礎実習、機械創造実習、機械工学実験
- ・実験測定機：万能試験機、走査電子顕微鏡、非接触表面形状測定機

研究内容：

○万能試験機

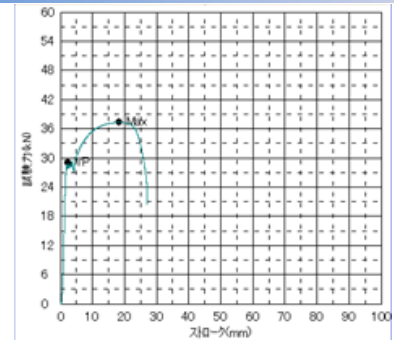
最大荷重：300kN

引張試験：最大つかみ具間距離 800mm

丸棒用つかみ具 φ8~40mm

圧縮試験：最大圧盤間距離 720mm

圧盤の大きさ φ100mm



○走査電子顕微鏡

分解能：高真空モード 3.0nm (30kV)・15.0nm (1.0kV)

低真空モード 4.0nm(30kV BED)

倍率：5~300,000 倍

加速電圧：0.3kV~30kV

エネルギー分散型 X線分析装置



○非接触表面形状測定機

測定原理：走査型白色干渉法 (SWLI)・周波数領域解析 (FDA)

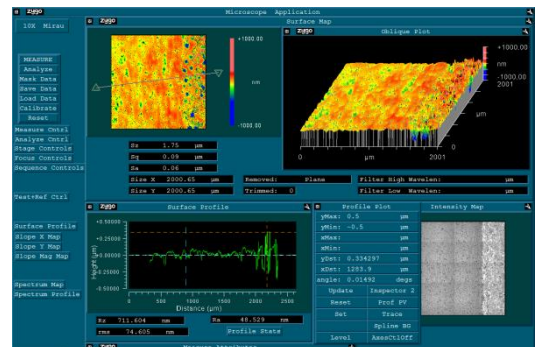
垂直分解能：<0.1nm

垂直走査範囲：≤20000 μm

光源：白色 LED

対物レンズ： 倍

試料寸法 (H×W×D)：89mm×127mm×144mm



提供可能な設備・機器：

名称・型番(メーカー)

名称・型番(メーカー)	